

## SPZ-EV40

圧電材料の単結晶化を  
可能にする下地層  
(ZrO<sub>2</sub>)の成膜に最適な  
真空蒸着装置です



## ■ 特長

- ・単結晶圧電薄膜に不可欠な下地層成膜が可能
- ・基板回転機構により優れた膜厚分布および再現性を実現
- ・搬送室予備ポートに蒸着チャンバーを増設可能

## ■ 仕様

基板サイズ	Φ8inch (オプション: Φ6inch)
基板ユニット	基板回転機構、基板バイアス
基板加熱	ハロゲンランプヒーター / 最高800℃
蒸着材料	Zr (ジルコニウム)
Zr参考使用量	ルツボ投入重量 100g
膜厚制御	水晶振動子式膜厚センサ
真空排気	クライオポンプ、ドライポンプ
蒸着室真空圧	5.0E-5Pa以下
参考成膜レート	0.3 Å/sec
制御系	PLC制御
操作系	デスクトップPC、液晶モニター

## ■ ユーティリティ (蒸着チャンバー1台仕様)

電源	50/60Hz、3φ、AC200V、42kVA
接地	A種
使用ガス	O <sub>2</sub> (プロセス) : 0.1~0.2MPa
	Ar (プロセス) : 0.1~0.2MPa
	N <sub>2</sub> (リーク、再生) : 0.1~0.2MPa
冷却水	20~25℃ 45L/min以上
圧縮空気	0.5~0.7MPa
クリーンドライエア	0.5MPa 100NL/min以上

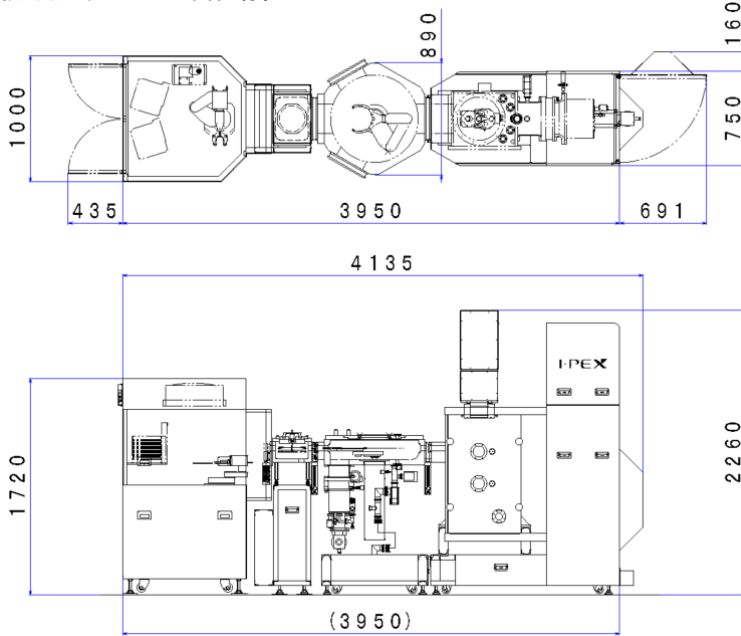
※蒸着材料、使用ガス、冷却水チラーは付属していません。

※記載の仕様・寸法等は予告なく変更することがあります。

# SPZ-EV40

## ■外形寸法図 [mm]

(蒸着チャンバー1台仕様)

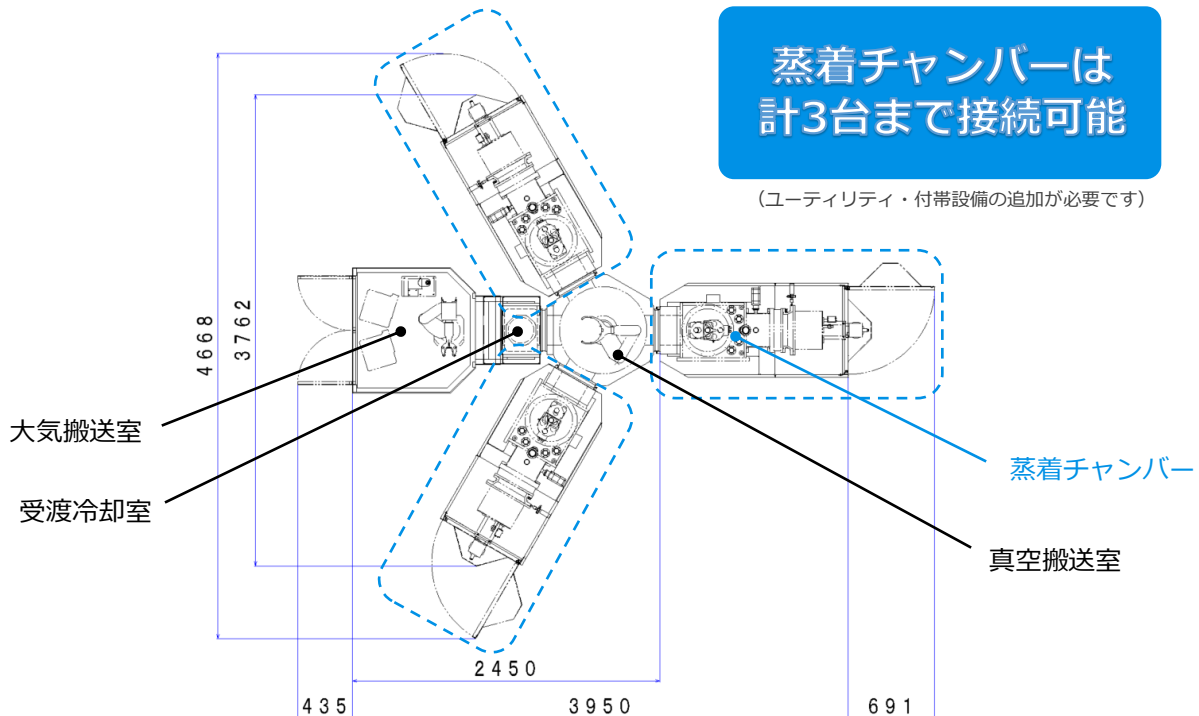


## ■付帯設備寸法 [mm]

制御盤ラック	: W570×D870×H1850
電子銃電源	: W570×D700×H1400
コンプレッサ	: W340×D580×H665
ドライポンプ	: W230×D450×H275
トランスボックス	: W450×D550×H575
デスクトップPC	: W383×D321×H154
液晶モニター(×2)	: W565×D175×H433

蒸着チャンバーは  
計3台まで接続可能

(ユーティリティ・付帯設備の追加が必要です)



※記載の仕様・寸法等は予告なく変更することがあります。